

고순도 Ptfе 가스 세척병 내부식성 맞춤형 가스 흡수 장치 1/4인치 튜브 연결

품목 번호: PL-CP192



소개

극한의 화학 환경에 맞춰 설계된 이 맞춤형 PTFE 가스 세척병은 보편적인 내부식성과 고순도 가스 흡수를 제공합니다. 1/4인치 튜브에 최적화되어 있어 민감한 산업용 응용 분야에서 누설 방지 성능과 정밀한 습도 조절을 보장합니다.

자세히 알아보기

| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|------------|--|---|
| 미량 금속 분석 | ICP-MS와 같은 고감도 분석 기기에 들어가기 전에 캐리어 가스에서 불순물을 제거하는 데 사용됩니다. | 용출 가능한 오염 물질을 제거하여 배경 노이즈를 방지하고 sub-ppb 검출 한계를 보장합니다. |
| 반도체 가스 처리 | 웨이퍼 에칭 및 세척 단계에 사용되는 부식성 프로세스 가스(예: HF, HCl)를 스크러빙합니다. | 고순도 PTFE는 반도체 장치 수율을 망칠 수 있는 금속 이온 오염을 방지합니다. |
| 환경 시뮬레이션 | 제어된 기후 조건 하에서 재료의 열화 메커니즘을 테스트하기 위해 특정 습도 환경을 생성합니다. | 기계식 분무기에 비해 매우 안정적이고 균일한 습도 기술기를 제공합니다. |
| 석유화학 정제 | 파일럿 플랜트 반응기의 가스 스트림에서 황화수소(H ₂ S) 또는 기타 산성 성분을 흡수합니다. | 거의 보편적인 내부식성은 극도로 공격적인 황화 환경에서 장기 운영을 보장합니다. |
| 제약 합성 | 특수 반응 경로에서 액체 촉매 또는 흡수 버퍼를 통해 시약 가스의 흐름을 제어합니다. | 완전히 불활성인 반응 환경을 제공하여 최종 API(유효 성분)의 순도를 보장합니다. |
| 배터리 연구 | 배터리 충전/방전 사이클 동안 전해질 테스트 및 가스 발생 분석에 사용됩니다. | 부식성 전해질을 견디고 체적 분석을 위해 가스 포집을 정밀하게 제어합니다. |
| 에어로졸 연구 | 특정 증기압을 달성하기 위해 제어된 버블링을 통해 가스 스트림을 사전 조건화합니다. | 정밀 가공은 최적화된 기포 크기와 분포를 허용하여 흡수 효율을 향상시킵니다. |
| 맞춤형 실험실 설정 | 특수 화학 공학 작업을 위해 맞춤형 진공 라인 또는 압력 조절 매니폴드에 통합됩니다. | 맞춤형 포트 크기 및 볼륨은 비표준 실험실 공간에 완벽하게 맞도록 합니다. |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 특징 | PL-CP192에 대한 사양 세부 정보 |
| 제품 식별자 | PL-CP192 맞춤형 PTFE 가스 세척병 |
| 재료 구성 | 고순도 순수 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) |
| 맞춤화 범위 | 완전히 맞춤화 가능한 치수, 볼륨 및 포트 구성 |
| 표준 인터페이스 | 1/4인치 튜브 커넥터 (요청 시 맞춤 크기 가능) |
| 화학적 내성 | 모든 일반적인 산, 염기 및 유기 용제에 불활성 (pH 0-14) |
| 작동 온도 | -200°C ~ +260°C (넓은 범위에서 일관된 성능) |
| 제조 프로세스 | 고체 PTFE 블록에서 정밀 CNC 가공 |
| 밀봉 메커니즘 | 통합 밀봉 링이 있는 나사형 PTFE 캡 |
| 세척 호환성 | 오토클레이브 가능; 강력한 세척제 및 초음파 세척기와 호환 |
| 표면 마감 | 잔여물 축적을 최소화하는 부드럽고 낮은 에너지 표면 |
| 딥 튜브 설계 | 맞춤화 가능한 길이 및 팁 스타일 (예: 직절단 또는 프릿형) |